

# DIN 32567-4:2015-06 (D)

## Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 4: Prüfkörper für optische Verfahren

---

| Inhalt  | Seite |
|---|-------|
| Vorwort .....   | 3     |
| Einleitung .....  | 4     |
| 1 Anwendungsbereich .....   | 5     |
| 2 Normative Verweisungen .....  | 5     |
| 3 Begriffe .....  | 5     |
| 4 Anforderungen an die Prüfkörper.....  | 5     |
| 4.1 Allgemeines .....   | 5     |
| 4.2 Anforderungen an die Abmessungen der Schicht .....  | 6     |
| 4.3 Anforderungen an Ebenheit, Welligkeit und Rauheit von Schicht und Substrat .....                              | 7     |
| 4.3.1 Allgemeines .....   | 7     |
| 4.3.2 Konstanz der Schichtdicke .....   | 7     |
| 4.3.3 Ebenheit des Substrates .....   | 7     |
| 4.3.4 Welligkeit des Substrates .....   | 7     |
| 4.3.5 Rauheit des Substrates.....   | 7     |
| 5 Prüfkörper für topographische Schichtdickenmessungen.....   | 7     |
| 5.1 Allgemeines .....   | 7     |
| 5.2 Prüfkörper Typ A .....  | 8     |
| 5.2.1 Allgemeines .....   | 8     |
| 5.2.2 Schichtsysteme .....  | 9     |
| 5.2.3 Referenzobjekte.....  | 10    |
| 5.3 Ergänzende Testobjekte für optische Verfahren .....   | 11    |
| 5.3.1 Testobjekt O1 zur Bestimmung der effektiven numerischen Apertur .....                                       | 11    |
| 5.3.2 Testobjekt O2 zur Bestimmung der elektromagnetischen Oberfläche in einem<br>volumenstreuenden Material..... | 11    |
| 5.3.3 Testobjekt O3 zur Bestimmung des Phasensprungs bei Reflexion .....  | 12    |
| Literaturhinweise.....  | 13    |